# (19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-115102 (P2001-115102A)

(43)公開日 平成13年4月24日(2001.4.24)

(51) Int.CL'	識別記号	FΙ	デ-73-h*( <b>参考</b> )
C 0 9 J	5/00	C 0 9 J 5/00	4 J 0 4 0
// B64G	1/50	B 6 4 G 1/50	Z

# 審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 9 頁)

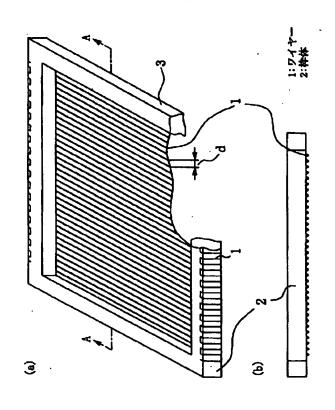
		·
(21)出願番号	特膜平11-295099	(71)出顧人 000006013
		三菱電機株式会社
(22)出顧日	平成11年10月18日(1999.10.18)	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
		(72)発明者 名取 康幸
		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三
	•	菱電機株式会社内
		(74)代理人 100102439
		弁理士 宮田 金雄 (外2名)
		Fターム(参考) 4J040 LA01 LA08 LA11 MB04 MB05
		NA17 NA19 PA25 PA35 PB01
		PB08 PB11
		·
	•	

# (54) 【発明の名称】 平板の接着方法および接着工具

# (57)【要約】

【課題】高粘度接着剤を用いた平板の接着において、接 着層内に残留する気泡を減少させるとともに、一定の接 着厚を確保する。

【解決手段】所望の接着厚と同等な太さのワイヤーを用 いて平板に接着剤を塗布し、ワイヤーを除去して接着層 に一方向の溝を形成後、平板を被接着物に接着し、この 構と平行に平板上端部より一方向にローラーにて加圧す る事により、この溝を利用して気泡を排出するととも に、気泡の接着層内への内在を抑制する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】互いに離間して一方向に並列に張られた複数のワイヤを平板の一方の面に置く第1の工程と、前記ワイヤの置かれた状態で前記平板の一方の面に高粘度接着剤を塗布する第2の工程と、前記ワイヤーを外し、前記平板の一方の面を被接着物の接着面に貼り付ける第3の工程と、前記被接着物の接着面に貼り付けられた前記平板の他方の面に加圧体を当接させ、前記一方向と略平行な向きにこの加圧体を移動させて加圧する第4の工程とを有する平板の接着方法。

【請求項2】前記第1の工程において、前記ワイヤを1 ~5mm程度のピッチで配置したことを特徴とする請求項1記載の平板の接着方法。

【請求項3】前記ワイヤは0.5~0.02mmの経を有し、前記第2の工程において当該ワイヤ径と同じ厚みで前記高粘度接着剤を塗布することを特徴とする請求項1記載の平板の接着方法。

【請求項4】前記第4の工程において、前記加圧体はローラーであることを特徴とした請求項1記載の平板の接着方法。

【請求項5】前記高粘度接着剤は、粘度50000CP S以上としたことを特徴とする請求項1記載の平板の接 着方法。

【請求項6】前記被接着物の接着面は放熱面であることを特徴とする請求項1 記載の平板の接着方法。

【請求項7】前記平板は熱放射面を形成することを特徴とする請求項1記載の平板の接着方法。

【請求項8】平板に高粘度接着剤を塗布するための接着 工具において、高粘度接着剤を塗布するための開口を有 した枠体と、一方向に並列に張られて前記開口面に配設 され、両端が前記枠体に支持された複数のワイヤとを備 えた接着工具。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、例えば人工衛星や宇宙機器などに搭載されるラジエーターにおいて、衛星構体パネルの外表面(以下熱制御面とする)に接着され、宇宙空間に熱を放射するオプティカルソーラーリフレクター(以下OSRと記す)などの平板に関し、特に高粘度接着剤を用いた接着方法及び、そのための接着治具に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】図17はOSRの構成を示す図である。図において、9は衛星構体の1部分を構成し、内部搭載機器の発熱による熱を伝導により外表面に伝えるアルミを素材としたハニカムパネル、5は例えばボロン系のガラス6の下部に、銀等の金属7を数十層蒸着したもので構成されるOSR、8はOSR5の金属7側をハニカムパネル9の外表面(熱制御面)に接着する高粘度接着剤である。OSR5は外部(宇宙空間)からの太陽光20

を反射し、ハニカムパネル9に伝導された内部搭載機器からの熱19を宇宙空間に放射する放熱特性を持ったものである。OSR5は0.5~1㎜程度の厚さの非常に薄いものであり、大きさは20~80㎜角程度の板状のものである。人工衛星への実装形態は、図18に示すように衛星構体を構成するハニカムパネル9上に、0.5~0.1㎜程度の間隔 a でタイル状に(衛星規模により数枚~数千枚)配置される。又、接着剤8として、非常に粘度が高い50000CPS以上の、例えばシリコン系接着剤等を使用し、0.05~0.5㎜程度の接着の厚さでOSR5を接着する。この時の接着層の厚さは、接着強度を保つとともに熱伝導率を一定にする為に厚さを均一にする必要がある。

【0003】このOSRを例えばアルミ板、アルミハニ カムパネル等の熱制御面に貼りつける場合、従来の接着 方法として次の2つの方法が提案されていた。

【0004】[方法1]まず、第1の接着方法について説明する。図19は接着剤を均一に塗布する為のメッシュ状のマスク(メッシュマスク)であり、太さ0.01mm程度の太さを持って十字に編んだワイヤ10とそのワイヤを保持する枠体2で構成され、各ワイヤ10のピッチbは0.01~0.05mm程度である。このメッシュマスクを介して軟質プラスチック等で出来た板状の厚さ10mm程度のスキージを70°程度の角度で立てて接着剤を延ばすことによりマスクを構成するワイヤ10の直径と同等の厚さで接着剤を均一に塗布することができる。

【0005】 [方法2] 次に、第2の接着方法について 説明する。図20は接着剤を一定の厚さで塗布する為の メタルマスクであり、接着剤8の目標とする接着層の厚 さと同等の厚さを有するステンレス製板材に対してエッ チング又はレーザ加工を行い、開口12を形成したメタ ルマスク11の周囲を、枠体2で囲んで成形したもので ある。このメタルマスクを使用し、接着剤を第1の接着 方法で述べたスキージにより塗布することにより、マス クの厚さと同等の接着剤塗布厚を得る。

### [0006]

【発明が解決しようとする課題】従来のOSRの接着は 上述のような方法で行われていたが、その接着工程にお いて次のような問題があった。

【0007】従来の第1の接着方法における第1の問題点として、図19に示したメッシュマスクを用いて接着剤を塗布した場合、接着剤塗布後、OSR5上からメッシュマスクを除去する時に表面張力により接着剤が引っ張られ、図21に示すような突起15が形成される。熱制御面にOSR5を接着する時点で図21に示すように、突起部分15が先に接触し中に気泡13が閉じ込められ逃げ場がないために気泡13が接着層の中に内包されてしまう。この気泡13はメッシュマスクのピッチとほぼ同等な大きさ(直径0.01~0.05mm程度)であり、メッシュマスクの目とほぼ同じ数だけ気泡が発

生する。この気泡自体の熱伝導率が接着剤に比較して著 しく悪いことから、熱伝導性の低下につながり、その結 果衛星内部の熱放射を妨げることになる。第2の問題点 として接着強度及び、熱伝導率を一定に保つ必要性から 接着層の厚さを0.05~0.5㎜に保つ必要がある が、メッシュマスクを構成するワイヤーの径0.01mm 程度で接着層の厚さが決まるため、規定値を満足させる ことが出来ない。一方、規定の接着層の厚さを満足させ ようとした場合、ワイヤーを太くする必要があるが、メ ッシュを構成するワイヤーには交差する点が存在する 為、太くした場合にその部分の段差によりスキージが引 っかかり、均一な接着厚さで接着剤を塗布することの妨 げとなる。その為、メッシュマスクを使用した場合に接 着層を厚くすることができないという問題があった。さ らに第3の問題点として、接着剤塗布後、メッシュマス クをOSR5上から取り外す場合にマスクとOSR5上 の接着剤との接触面積が大きい為に密着性が強く、マス クの取り外しが困難となる問題があった。

【0008】次に、従来の第2の接着方法における問題 点として、接着剤を塗布する場合に、使用するメタルマ スクの構造上、強度的に図20に示すように最小幅の制 限c(約2mm程度)があり、これにより適正間隔で配 置されたOSR上に接着剤を塗布した場合、マスク幅の 分、接着剤が塗布されない部分が生じ、接着面積の減少 につながり熱伝導率が低下するという第4の問題があっ た。又、第5の問題として、マスク取り外し時に図20 に示すマスク開口部12の外形形状に沿った形で、図2 3に示すように突起15が形成され、図24に示すよう に接着時に突起部分が先に衛星構体の熱制御面と接触し 気泡を閉じ込めてしまう。その後加圧しても気泡の逃げ 場がない為、比較的大きな気泡 (5mm以上) が発生す ることになる。これは又、接着面積の減少による熱伝導 率の低下、真空中における気泡の膨張によるOSRの破 損などにつながっていた。

【0009】この発明は上記の課題を解決する為になされたものであり、人工衛星搭載用のOSRなどの平板を高粘度接着剤を用いて接着する場合の気泡の混入を抑止するとともに、一定の接着厚を確保し、人工衛星の構体パネルなどの被接着物に安定した熱放射特性を得ることを目的とする。

# [0010]

【課題を解決するための手段】第1の発明による平板の接着方法は、互いに離間して一方向に並列に張られた複数のワイヤを平板の一方の面に置く第1の工程と、前記ワイヤの置かれた状態で前記平板の一方の面に高粘度接着剤を塗布する第2の工程と、前記ワイヤーを外し、前記平板の一方の面を被接着物の接着面に貼り付ける第3の工程と、前記被接着物の接着面に貼り付けられた前記平板の他方の面に加圧体を当接させ、前記一方向と略平行な向きにこの加圧体を移動させて加圧する第4の工程

とを有したものである。

【0011】第2の発明による平板の接着方法は、前記 第1の工程において、前記ワイヤを1~5mm程度のピッチで配置したものである。

【0012】第3の発明による平板の接着方法は、前記 ワイヤにおいて0.5~0.02mmの径を有し、前記 第2の工程において当該ワイヤ径と同じ厚みで前記高粘 度接着剤を塗布したものである。

【0013】第4の発明による平板の接着方法は、前記 加圧体をローラーとしたものである。

【0014】第5の発明による平板の接着方法は、前記 高粘度接着剤の粘度を50000CPS以上としたもの である。

【0015】第6の発明による平板の接着方法は、前記被接着物の接着面は放熱面としたものである。

【0016】第7の発明による平板の接着方法は、前記 平板は熱放射面を形成したものである。

【0017】第8の発明による接着工具は、平板に高粘度接着剤を塗布するための接着工具において、高粘度接着剤を塗布するための開口を有した枠体と、一方向に並列に張られて前記開口面に配設され、両端が前記枠体に支持された複数のワイヤとを備えたものである。

#### [0018]

【発明の実施の形態】実施の形態1. 図1はこの発明の実施の形態におけるOSRの接着工具であるワイヤーマスクの外観を示す図であり、図1 (a) はワイヤーマスクの斜視図、図1 (b) は図1 (a) の矢視AA方向の断面図を示し、図2はこの実施の形態におけるOSRの接着工程を示す図である。

【0019】図1において、1は直径0.1~0.5mm 程度の太さのワイヤー、2は口の字型で外枠の外形寸法が例えば500mm×500mm角程度の大きさであり、かつ内側に矩形状の開口を有し、互いに対向する両側面に複数本の平行な構が設けられたアルミニウムを素材とする枠体2であり、ワイヤー1を1~5mm程度の同じ設けられたアルミニウムを素材とで枠体2の底面に平行に配置し、一定のテンションを表現隔はで枠体2の底面に平行に配置し、一定のテンションを形成でリイヤの両端を枠体2の両面に設けられた溝に引っかけ固定することによりワイヤーを折り返しながるように1本のワイヤーを折り返しながるように1本のワイヤーを折り返しながあように1本のワイヤを折り返しながるように1本のワイヤを枠体2の底面に平行に張ってもよい。このように1本のワイヤとすることにより、ワイヤの張替え作業が容易になる。

【0020】このように構成されたワイヤーマスク3を用いて、図2に示す以下の工程でOSRの接着を行う。まず、図3に示すように真空吸着台16上に、複数枚のOSR5を所定の間隔(例えば0.1~0.5mm間隔)で接着面を上にして配置し、OSR5を真空吸着台16に吸着させる(ステップS1)。次に、OSRの接

着面上にワイヤーマスク3をセットする(ステップS2)。図4はワイヤーマスク3におけるワイヤー1をOSR5上にセットした状態を示す。このとき、ワイヤーマスク3がOSR上でずれないように、真空吸着台16に突起を設けてワイヤーマスク3が台に水平な方向にずれないように固定する、あるいはワイヤーマスク3の2箇所の隅にそれぞれピン(全部で2本)を設けて真空吸着台16に設けた穴に嵌合させてもよい。

【0021】ワイヤーマスク3をセットした後、ワイヤ ーマスク3上に接着剤を滴下し(ステップS3)、例え ば硬質プラスチック等で出来た厚さ10mm程度で先端 を剣型に加工されたスキージ4を、図5に示すようにワ イヤー1上で移動させて、接着剤8をワイヤー1の太さ と同じ厚さで均一に塗布する(ステップS4)。図6は 接着剤8が塗布されたOSR5の状態を示す拡大図であ る。次に、図7に示すようにワイヤーマスク3を上方向 に一定の力で引き上げてワイヤー1を除去し(ステップ S5)、これによって引き上げ前に接着層内でワイヤー 1が置かれていた位置に、図8に示すような一方向で多 数の平行な溝14が形成される。この時、従来の第1の 接着方法で示したメッシュマスクと同様、接着剤8の表 面張力によりワイヤー1に接着剤が引っ張られて突起1 5が形成されるものの、ワイヤーマスク3の使用ワイヤ ーが太いため、従来の第1の接着方法で示したメッシュ マスクとは異なり接着層内に溝14が残る。

【0022】その後、真空吸着台16を回転させ、接着 剤が塗布されたOSR5の上面が下方を向くように反転 し(ステップS6)、OSR5を被接着物であるハニカ ムパネル9の接着位置へ移動し、所定の接着位置に載 せ、OSR5への真空吸着を解除し真空吸着台を除去す る (ステップS7)。この時の状態の部分拡大図を図9. に示す。この後、例えば5mm程度のスポンジ等の軟質。 材をローラーの面にまいたローラー17にて、図10に 示すようにOSR5を所定の圧力で加圧した状態で、ロ ーラー17をOSR5の端部より溝14と平行な一定の 方向に移動させることによって、接着層内に内含された 気泡を溝14に沿って排出する (ステップS8)。この 時、気泡は始めワイヤー1によって形成された突起によ り閉じ込められる形となり図11の気泡13のようにな るが、従来の第2の接着方法で示したメタルマスクと異 なり1~5mm程度の狭い間隔で形成されているため、 上方向からの加圧によって図12に示すように気泡13 が圧縮されたときに、気泡13と溝14との間が狭い為 に接着剤が気泡13の広がる力に抗しきれず、図13に 示すように穴が空き気泡13が溝14と連通する。その 後、OSR5を加圧した状態でローラー17を一定の方 向に移動させることにより、複数の互いに平行に形成さ れた溝14に沿って一方向に気泡内の空気が流れ出し、 風船が縮むように気泡13が収縮する。さらにワイヤー マスク3により形成された溝14についても加圧により

この溝に沿って空気が排出され、ローラー17の移動に 伴って図14に示すように溝14が次々と収縮し、最終 的には図15に示すように気泡がすべて排出される。

【0023】尚、この時ローラーはOSR5の端部より一方向に溝14と平行に加圧しなければならず、複数方向や、溝と直角に加圧した場合には溝が分断される為、気泡の逃げ場がなくなる。また、図2のステップ1から8の工程は、OSR5の設置や接着剤の塗布にマニュピレータを用いたり、OSR5の加圧にベルトコンベアを用いるなど、適宜自動化して行っても良いことは言うまでもない。

【0024】図16において、従来のメッシュマスクを用いた従来の第1の接着方法およびメタルマスクを用いた従来の第2の接着方法と、この実施の形態の接着方法との、接着状態および作業性に関する対比図を示す。図に示すとおり、この実施の形態の接着方法は従来の第1、第2の接着方法と比べて、接着面積が大きくかつ接着層内に内在する気泡もほぼ見られず優れた接着方法を提供するものである。特に、この接着方法を用いて人を提供するものである。特に、この接着方法を用いて人を接着することにより、接着層内の気泡が抑制されるため、この気泡の内在による熱伝導率の低下、及び真空中における気泡の膨張によるOSR破損などによって発生する熱放射特性の劣化を防止できる。

【0025】また保守面においても、メッシュマスクや メタルマスクを用いて、繰り返し接着剤の塗布やマスク の除去を行うことにより、メッシュマスクにおけるワイ ヤーが摩耗する、あるいはメタルマスクにおける開口1 2のエッジが摩耗または欠損する。この場合、従来のメ ッシュマスクでは、ワイヤーの張替時にワイヤーを十字。 に編んで所定のテンションで張るため、その張替え作業 が難しく時間を要してコスト高になった。また、従来の メタルマスクにおいてはマスクごと交換しなければなら なかった。さらに、接着工程終了後にマスクの清掃を行 う場合でも、従来のメッシュマスクでは、ワイヤーのク ロス部分に接着剤が詰まり清掃が困難であり、また従来 のメタルマスクにおいては、開口12のエッジ部分に引 っ掛かりが生じて清掃しずらかった。しかしこの実施の 形態の接着方法で用いるワイヤーマスク3は、ワイヤー を一方向のみに張り、しかもそれ程高いテンションで張 らなくても良いため、ワイヤーの摩耗等によってワイヤ ーを張替る場合でも容易に張り替えができる。また、ワ イヤに沿ってあるいはワイヤに垂直な方向に清掃するこ とで、容易に接着剤を除去できる。このため、保守の点 で費用低減が図れ、しかもマスクの清掃がし易い点で非 常に優れている。

#### [0026]

【発明の効果】この発明は以上説明したように構成されるので、以下に記載するような効果を奏する。

【0027】平板を被接着物へ接着する際の接着層の気

泡を抑制することにより、この気泡による熱伝達率の低 下及び真空中における気泡の膨張による放熱特性の劣化 を防止できる。

【0028】また、ワイヤーを設けた接着工具の製造に関してもエッチング又はレーザー加工等が必要なく、またその保守面に関しても、ワイヤーの摩耗等によるワイヤーの張替ですむことから費用低減が可能である。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1によるワイヤーマスクの構成を示す図である。

【図2】 この発明の実施形態1によるワイヤーマスクを用いたOSRの接着工程を説明する図である。

【図3】 OSRを真空吸着台の上に並べた状態を示した図である。

【図4】 ワイヤーマスクをOSR上にのせた状態を示す図である。

【図5】 ワイヤーマスクを用いて接着剤をスキージに て塗布している状態を示した図である。

【図6】 ワイヤーマスク上から接着剤を塗布した状態を示した図である。

【図7】 ワイヤーマスクをOSR接着面より持ち上げた状態を示した図である。

【図8】 OSRへ接着剤を強布後、ワイヤーマスクを 除去し、溝を形成した状態を示す図である。

【図9】 ワイヤーマスクにて接着剤を塗布したOSR を衛星構体に貼り付けた状態を示した図である。

【図10】 OSRをローラーにて加圧している状態を示した図である。

【図11】 OSRを衛星構体に貼り付けたときの接着 層の状態を示す側面図である。

【図12】 OSR上からの加圧により気泡が圧縮され 横方向に広がった状態を示した図である。

【図13】 気泡がワイヤーマスクにて形成された溝へ 排出される過程を示した図である。

【図14】 ワイヤーマスクにて形成された溝が収縮する過程を示した図である。

【図15】 OSRが適正な状態で接着された状態を示

す図である。

【図16】 従来の接着方法のメッシュマスク、及びメ タルマスクと、実施の形態1のワイヤーマスクとの比較 対照図である。

【図17】 OSRの構成を示す図である。

【図18】 OSRの衛星構体への実装形態を示す図である。

【図19】 従来のメッシュマスクの構成について示した図である。

【図20】 従来のメタルマスクの構成について示した 図である。

【図21】 メッシュマスクをOSR接着面より持ち上げた状態を示した図である。

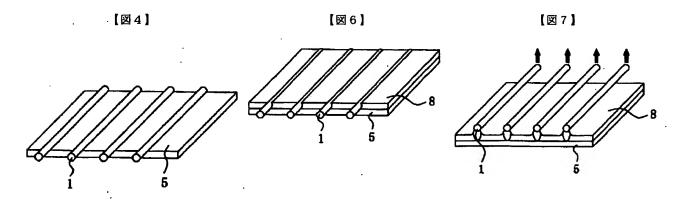
【図22】 メッシュマスクにて接着剤を塗布したOS Rを衛星構体に貼り付けた状態を示した図である。

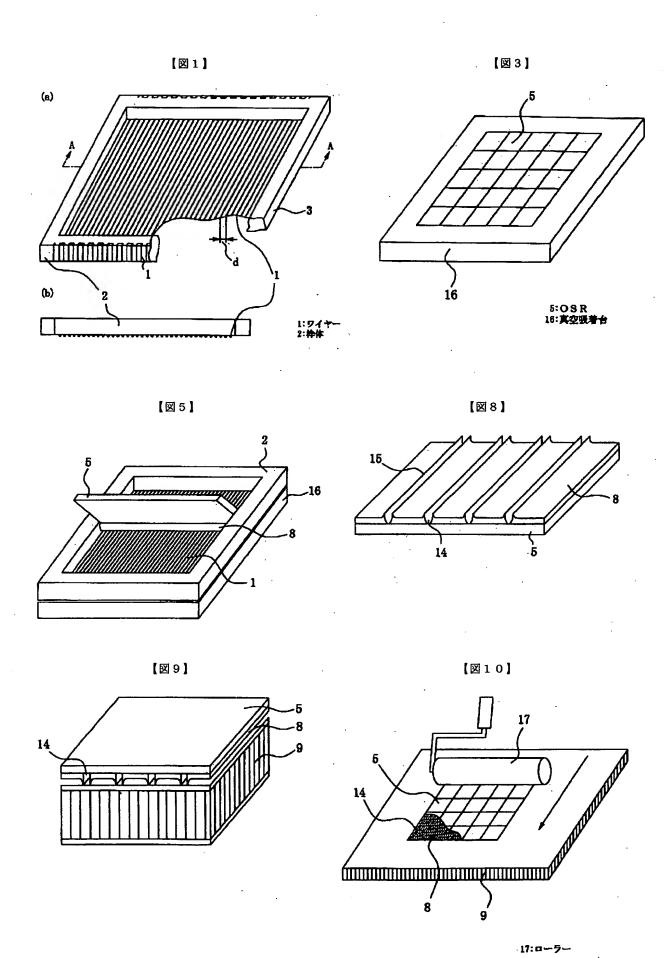
【図23】 メタルマスクをOSR接着面より持ち上げた状態を示した図である。

【図24】 メタルマスクにて接着剤を塗布したOSR を衛星構体に貼り付けた状態を示した図である。

#### 【符号の説明】

- 1 ワイヤー
- 2 枠体
- 3 メタルマスク
- 4 スキージ
- 5 OSR
- 6 ガラス
- 7 蒸着膜
- 8 接着剤
- 9 ハニカムパネル
- 10 メッシュマスク
- 11 メタルマスク
- 13 気泡
- 14 溝
- 15 突起
- 16 真空吸着台
- 17 ローラー

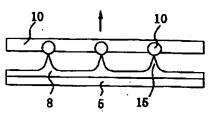




【図16】

	ワイヤーマスク		メッシュマスク		メタルマスク	
	評価	自为	評価	信号	評価	傷考
OSRの面積に対する 接着面積の割合 (気泡の影)	0	98%以上 (ほぼなし)	×	90%以上 (多數発生)	×	80から90% (中程度)
気砲の大きさ	0	直径5mm 以下	0	直径5mm 以下	×	直径fem 以上
接着知識布後のマスクの 外しやすさ	0	良好	×	₩,	Δ	中程度
接着軍の管理	0	良好	Δ	良好である が調整幅が せまい	0	投好
マスクの情報しやすさ	0	良好	×	劉小	Δ.	中程度
マスクの保守	0	低価格で ある	×	コストが かかる	×	コストが かかる

【図21】



O: Δ: 町 X: 不可

